



SPG-20 型

# 厚膜制御プログラム

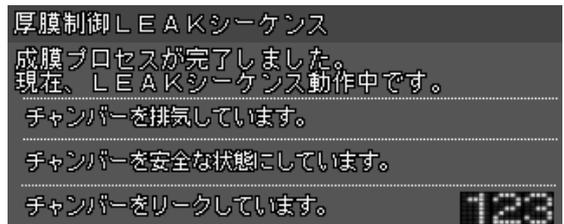
HPC-20 型オスミウムコーター専用

## 特徴

- このプログラムは、100nm程度のオスミウム膜を成膜するための専用プログラムです。
- FIB保護膜等の厚い膜を成膜するためのプログラムです。
- 成膜回数、成膜時間、オスミウムガスチャージ時間の設定が可能で、1工程での処理が可能です。
- 完全自動制御により、成膜中は時間を有効に活用できます。



装置外観



株式会社 真空デバイス

〒311-4155

茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601